

スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会 (SP 部会)

第 164 回定例研究会

テーマ：「スパッタ等の真空プロセスでつくる発光・受光デバイス」

LED やフォトダイオード、太陽電池などソリッドステートの発光・受光デバイスは、既に私たちの暮らしになくはないものになっています。当初これらのデバイスの発光層やパッシベーション層の作製には CVD が用いられてきましたが、大面積化やコストの要求から、スパッタプロセス・プラズマプロセスの適用例も多く見られるようになってきました。今回の研究会では、スパッタや ALD プロセスに様々な工夫をこらし、これらの物性改善に繋げた例を紹介いただきます。また会の冒頭では、2019 年度 SP 部会賞の授賞式ならびに記念講演も実施します。今回の研究会は当初 3 月に予定されていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け延期となっております。現在も対面での実施が困難なことから、今回、Web 会議形式で開催する運びとなりました。研究会として初の試みとなりますが、多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日 時： 2020 年 9 月 7 日 (月) 13:00~16:45 (接続受付 12:30~)

場 所： Web 会議形式 (Zoom を予定) ※講演資料集冊子を、会議に先だって郵送します。
また当日のアクセスの詳細は、申込みいただいた方に別途ご案内します。

プログラム

13:00~13:05 開会の挨拶 日本表面真空学会 SP 部会 部会長 (京都大学) 後藤康仁

2019 年度 SP 部会賞授賞式

13:05~13:10 審査経緯の報告 日本表面真空学会 SP 部会 副部会長 (成蹊大学) 中野武雄
受 賞 者：東京電子株式会社、中谷達行 (岡山理科大学)、福江紘幸 (岡山理科大学)
受賞業績：HiPIMS 用プラズマ電源の開発

13:10~13:40 SP 部会賞受賞記念講演
「アーク抑制および成膜レート向上を目的とした大電力パルススパッタ電源の技術開発」
(東京電子(株)) 黒岩雅英

講 演： ※講演時間 40 分 (質疑応答 5 分間含む)

13:40~14:20 「機能性酸化物・窒化物薄膜の長尺低温形成に向けた反応性プラズマプロセスの開発」
(大阪大学) 節原裕一

14:20~15:00 「スパッタと高温アニールによる高結晶性 AlN 膜の作製」 (三重大学) 三宅秀人

15:00~15:20 休 憩

15:20~16:00 「原子層堆積法で作製した酸化チタンの高性能パッシベーション効果の発現機構」
(名古屋大学) 後藤和泰

16:00~16:40 「RF スパッタ堆積した酸化物半導体材料と透明インテリジェントデバイスの開発」
(東京理科大学) 杉山 睦

16:40~16:45 閉会の挨拶 日本表面真空学会 SP 部会 副部会長 (成蹊大学) 中野武雄

参 加 費： ※お支払い方法は、申し込み後にご案内します (お振込みをお願いする場合があります)。

SP 部会員	無 料	/	学生	5,000 円	/	一般	28,000 円
日本表面真空学会個人正会員							23,000 円
日本表面真空学会法人正会員、維持会員、賛助会員に属する方							18,000 円
教育機関、公的機関に属する方							12,000 円

申込方法： ホームページよりお申し込みください。 <https://www.jvss.jp/> (〆切 8/28(金) 15:00)

問合せ先： 公益社団法人日本表面真空学会 事務局

TEL: 03-3812-0266 FAX: 03-3812-2897 E-mail: office@jvss.jp

本件担当： 日本表面真空学会 SP 部会 (東海大学) 金子哲也, (成蹊大学) 中野武雄